

II 固体表面反応シミュレーションとその実証

II.1	超純水電気化学加工プロセスの第一原理分子動力学シミュレーションとその実証
II.2	EEM(Elastic Emission Machining)の加工現象のシミュレーション
II.3	固体表面の反応素過程シミュレーションによるプラズマCVM(Cheical Vaporization Machining)の加工メカニズムの解明
II.4	Si(001)表面上へのアンモニア分子解離吸着過程の第一原理分子動力学シミュレーション
II.5	ハロゲンおよび金属が吸着したSi(001)2×1表面の電子状態シミュレーションとSTM/STS(Scanning Tunneling Microscopy / Scanning Tunneling Spectroscopy)による実証
II.6	STM-AES・XMA(Scanning Tunneling Microscopy - Auger Electron Spectroscopy・X-ray Micro Analysis)における特性X線エネルギーおよびオージェ電子エネルギーの解析